

Wafer Marco Inspection



技術規格

Wafer type	Silicon wafer or Glass wafer
Wafer size	8" - 12"
Weight	2500 kg
Dimension	2176(W) x 1870(D) x 2387(H) mm

設備特性與優點

Wafer Auto Inspection Machine –具有多角度檢測視角，可取代人眼來判斷晶圓上的瑕疵。

- 具有多角度檢測視角，可取代人眼來判斷晶圓上的瑕疵。
- 具有明暗場光源，可針對不同的瑕疵類型作切換。
- 可適用於Silicon & Glass Wafer。
- Wafer 正背面皆可檢測。
- 視覺Edge Alignment。